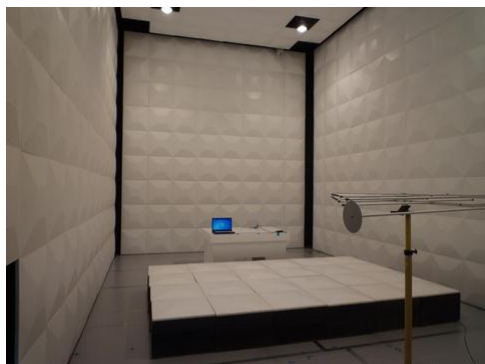




あいち産業科学技術総合センター
に整備された電波暗室

平成 26 年 12 月 10 日（水）

あいち産業科学技術総合センター
共同研究支援部 試作評価室
担当 浅井、川本
ダイヤルイン 0561-76-8316

愛知県産業労働部産業科学技術課
管理・調整グループ
担当 加藤、水野
内線 3389、3388
ダイヤルイン 052-954-6347

「計測分析に関する講演会」の参加者を募集します ーEMCに関する規格動向を踏まえた試験手法及び対策技術を紹介ー

あいち産業科学技術総合センターでは、様々な高度計測分析機器を用いた分析・評価により、企業の方々の研究開発や製品開発への取組みを支援しています。

電子機器から発生する電磁ノイズは、周囲の電子機器が誤動作を起こす原因となることがあります。そのため、電子機器には、意図しない電磁ノイズの発生を抑えることに加え、電磁ノイズを受けても誤動作を起こさないこと（EMC^{*1}：電磁両立性）が求められます。

今回、電磁環境試験に携わる技術者に関心の高い「EMC規格及び試験方法」と「EMC対策技術」に焦点をあてた講演会を、平成 27 年 1 月 22 日（木）に、あいち産業科学技術総合センター（豊田市）にて開催します。

講演後には、当センターの分析機器の紹介及び隣接するあいちシンクロトロン光センター^{*2}の見学会を行います。

参加は無料です。多くの皆様の参加をお待ちしております。

1 日時

平成 27 年 1 月 22 日（木） 午後 1 時 30 分から午後 5 時まで

2 場所

あいち産業科学技術総合センター 1 階 講習会室

住所：豊田市八草町秋合 1267-1 電話：0561-76-8316

（東部丘陵線リニモ「陶磁資料館南」駅 下車すぐ）

※会場へは公共交通機関を利用してお越しください。

3 主催等

主催：あいち産業科学技術総合センター

共催：（公財）科学技術交流財団

4 内容

- ・「EMC試験の基礎知識と試験実施上の留意点」

(午後1時35分～午後2時55分)

講師：株式会社テクノサイエンスジャパン

副社長 技術部管掌取締役 ^{やまだ かずのり} 山田 和謙 氏

- ・「ノイズ対策の勘所」

(午後3時5分～午後4時25分)

講師：北川工業株式会社 EMCセンター ^{すえたけ けいじ} 末武 景士 氏

- ・施設見学

あいち産業科学技術総合センター（電波暗室等）

あいちシンクロトロン光センター

(午後4時30分～午後5時)

5 参加費

無料

6 定員

100名（先着順）

7 申込方法

技術開発に取り組む企業の方々を始め、どなたでも自由に参加できます。

参加申込書に必要事項を記入の上、FAX、郵送または電子メールでお申込みください。

申込書は、あいち産業科学技術総合センターのホームページ

(<http://www.aichi-inst.jp/>) からダウンロードできます。

8 申込期限

平成27年1月20日（火）午後5時まで（必着）

※定員に達し次第締め切ります。ご了承ください。

※参加受付証は発行しません。お申込みの上、直接会場にお越し下さい。なお、定員超過の場合は連絡させていただきます。

9 申込先及び問い合わせ先

あいち産業科学技術総合センター 共同研究支援部

試作評価室 浅井、川本

〒470-0356 豊田市八草町秋合 1267-1

電話：0561-76-8316 FAX：0561-76-8317

mail：AIC00000001@chinokyoten.pref.aichi.jp

URL：http://www.aichi-inst.jp/

【用語説明】

用語	説明
*1 EMC (電磁両立性)	電磁両立性 (EMC: Electromagnetic Compatibility) とは、電気・電子機器について、それらから発する電磁ノイズが、ほかのどのような機器、システムに対しても影響を与えず、また、ほかの機器、システムからの電磁ノイズを受けても自身も本来の性能を維持する耐性。
*2 あいちシンクロトロン光センター	(公財)科学技術交流財団が運営する、ナノテク分野の研究開発を支援する最先端の計測分析施設。平成 25 年 3 月に「知の拠点あいち」にオープンした。愛称: Aichi SR。産業利用を主目的としており、あいち産業科学技術総合センターが備える高度計測分析機器との相互利用を図ることにより、地域企業の技術的な課題解決を強力に支援する。 なお、シンクロトロン光とは、ほぼ光速で直進する電子が電磁石によって進行方向を変えられた際に発生する電磁波。非常に明るく (通常の計測装置で用いる電磁波の千倍から百万倍)、1 台の装置でマイクロ波、赤外、可視、紫外から X 線まで連続した波長の光を出すことができる。この光を利用して様々な計測・分析を行う。

【参考】「計測分析に関する講演会」今後の開催予定

- 「金属・セラミックス材料の組成分析」～成分とその分布～
(平成 26 年 11 月 18 日記者発表済み)

日時: 平成 27 年 1 月 30 日(金) 午後 1 時 30 分から午後 4 時 45 分

場所: あいち産業科学技術総合センター 1 階 講習会室

内容: 走査電子顕微鏡 (SEM) を用いた材料の組成分布や、ICP 発光分析装置 (ICP-AES) ・蛍光 X 線分析装置 (EDS) による主成分・微量成分の分析について、様々な事例を紹介。

<http://www.pref.aichi.jp/0000077238.html>